

특허증

CERTIFICATE OF PATENT

특허

Patent Number

제 10-2243189 호

출원번호

Application Number

제 10-2020-0131322 호

출원일

Filing Date

2020년 10월 12일

등록일

Registration Date

2021년 04월 16일



발명의 명칭 Title of the Invention

진공 빔 프로파일링 장치

특허권자 Patentee

신호텍 주식회사(285011-*****)

서울특별시 금천구 가산디지털1로 19, 13층 1306호(가산동, 대륭테크노타운18차)

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2023년 07월 20일

특허청장

COMMISSIONER,
KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

이인신



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요

